



HERCULES® NIL

全モジュール統合型SmartNIL® UV-NIL装置300 mmまでの基板 に対応



イントロダクション

EVG SmartNIL® 技術を組み合わせた完全統合型のプラットフォームでAR/VR、3Dセンサー、フォトニクスやバイオテクノロジーなどのアプリケーションをサポート。

EVGのHERCULES NIL 300 mmは、洗浄、レジスト塗布、ベーキングの前処理工程と、直径300 mmまでの基板のウェーハレベル・大面積ナノインプリント・リソグラフィ(NIL)プロセスであるEVG独自のSmartNILを単一プラットフォームで組み合わせた完全統合型トラックシステムです。これは、EVGのモジュラー式プラットフォームをベースにした初のNIL装置であり、200 mmおよび300 mmウェーハのブリッジ機能を含め、お客様の生産ニーズに最も合うように装置内のモジュールを自由に構成することができます。

HERCULES NIL 300 mmは、低荷重やコンフォーマル・インプリント、そして高速ハイパワー露光やスムーズなスタンプの離型といった機能により、業界内で最も先進的なナノインプリント機能を提供します。この装置がサポートする様々なデバイスやアプリケーションには、拡張現実/仮想現実(AR/VR)向けヘッドセット用の光学デバイス、3Dセンサー、バイオメディカルデバイス、ナノフォトニクス、プラズモニクスなどがあります。

特長

- 全自動UV-NILインプリンティングと弱い力での剥離
- 直径300 mmまでの基板に対応
- 最大8つの交換可能なプロセスモジュール(インプリンティングおよび前処理)を備えた完全モジュラー型プラットフォーム
- 200 mm / 300 mm基板のブリッジ機能
- 基板全面への一括インプリント
- 40* nm以下の構造体の量産が可能
- 3Dを含む幅広い構造やサイズに対応
- 高段差(ラフ)表面に使用可能

*解像度はプロセスやパターンに依存

テクニカルデータ

ウェーハ径(基板サイズ)	200 - 300 mm まで
解像度	≤ 40* nm
対応プロセス	SmartNIL®
露光源	ハイパワーLED (i線) > 400 mW/cm ²
アライメント	± 3 μm
スタンプ離型	全自動
前処理	全ての前処理モジュールが利用可能
ミニエンバイロメントと雰囲気管理	オプション
ワーキングスタンプ形成	HERCULES装置内でのワーキングスタンプ自動形成

お問い合わせ

イーヴィグループジャパン株式会社
〒240-0005
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークウエストタワー1F
+81 45 348 0665

Sales@EVGroup.jp



www.EVGroup.com